イオン源の AI 制御に向けたビーム診断器の開発

DEVELOPMENT OF BEAM MONITOR FOR AI CONTROL OF ION SOURCE

森田泰之[#],福田光宏,依田哲彦,神田浩樹,畑中吉治,中尾政夫,安田裕介,鎌倉恵太,原周平,Koay Hui Wen, 武田佳次朗,原隆文,大本恭平

Yasuyuki Morita[#], Mitsuhiro Fukuda, Tetsuhiko Yorita, Hiroki Kanda, Kichji Hatanaka, Masao Nakao,

Yusuke Yasuda, Keita Kamakura, Shuhei Hara, Koay Hui Wen, Keijiro Takeda, Takafumi Hara, Kyouhei Omoto Research Center for Nuclear Physics, Osaka University (RCNP)

Abstract

The tuning of the ion source has a part that relies on human experience and intuition, and because the unknown parameters such as plasma, the reproducibility is low. Therefore, we apply machine learning, search for correlation between parameters and beams, and aim to improve the degree of reproducibility. In order to apply machine learning, it is necessary to know the conditions of beam in detail, and development of an emittance monitor, a beam profile monitor, and an environmental sensor as a diagnostic device is indispensable. In particular, the Emission Monitor is very important for making adjustments, and it is required to make a wide range of emittance measurements quickly. RCNP has developed Pepper-Pot Emittance Monitor (PPEM), and has achieved measurement at 4 Hz. This device is mainly intended for emittance measurement of 30π mm mrad or more, and needs to be improved to be able to measure low emittance beam in order to perform machine learning. Therefore, this time, we investigated the conditions of PPEM that can measure low emittance beam, and developed PPEM that can measure a wide range of measurement by replacing the pepper pot mask.

1. はじめに

現在、加速器は医療用 RI 生成をはじめとした医療応 用や廃棄核燃料の核変換技術などの産業利用が期待さ れている。加速器運転の際には実際のビームの状態を 見ながら状況に応じてパラメーターを調整する必要があ り、それには豊富な経験と熟練の技術が必要となる。一 方で社会に普及させる際は熟練の技術を持ったオペ レーターをすべての施設に配置することは不可能である ため、誰でも容易に行える新たな加速器運転システムを 開発する必要がある。その中でも筆者はイオン源の調整 は加速器で加速されるビームの量に直結するため、非常 に重要な要素である。そこで筆者は現在急速に発展して いる機械学習の技術を応用した、新たなイオン源運転・ 調整システムの開発を行っている。

イオン源調整の際には、ビームの状態を診断し、その 結果をもとにパラメーターを調整し、再度診断を行いそ の結果をもとに再度調整を行う。この調整を繰り返すこと でビームの量や質を向上させることができ、機械学習[1] を応用したイオン源調整の場合も同様のプロセスで調整 を行う。そのため、ビームの診断に要する時間はイオン 源の調整時間に直結するため、調整を効率的に行うた めには迅速なビーム診断が求められる。

そこで今回、迅速なビーム診断を可能にするために大阪大学核物理研究センター(Research Center for Nuclear Physics, RCNP)では、高速エミッタンス測定を目的としてPepper-Pot Emittance Monitor (PPEM)の開発を行っている。本装置はRCNPで運転中の5台のイオン源全てのビームに対してリアルタイムでの連続的な位相空間分布の測定、エミッタンス値の算出を目的としている。本装置

が完成することで機械学習を用いたイオン源制御の際に 現状のビームの是非を判断し、迅速に調整を行うことが 可能となる。

2. イオン源調整への機械学習の応用

一般的にはビームの電流値や実空間分布を測定し、 調整を行っている。これは主に、手動で調整する以上、 処理できる情報量に限りがあるためである。一方で機械 学習は多くの情報を一度に処理することができる。その ため、機械学習を応用することで、ビームとパラメーター の相関を探ることができると期待される。

機械学習をイオン源制御へ応用する際には、何をもっ てビームの量や質が最高であると判断させるかが大きな 問題となる。現状、この判断には加速器のアクセプタンス とビームのエミッタンスを比較することでビームの良し悪 しを判断するシステムを検討している。具体的には、まず 初めに加速器入射口でのアクセプタンスを測定する。そ して機械学習の回帰によって大まかに値にあたりを付け た後[2]、次にビームのエミッタンスを測定し、測定器から 加速器入射口までの輸送計算を行い、エミッタンスとアク セプタンスの比較を行うことで現状のビームの良し悪しを 判断する。エミッタンスがアクセプタンスにマッチしていな い場合、パラメーターの変更を行い、マッチするまで調 整を行う。調整の概念図を Fig.1 に示す。

この手法はビーム量だけでなく、エミッタンスやアクセ プタンスをもとの調整するため、より多くの情報を元に調 整を行うことができる。また、機械学習を応用することでこ れまでは調整の際に測定していなかった外部磁場や温 度などがビームに及ぼす影響を探ることができるようにな る。そのため、ビームとパラメーターの関係をより詳しく探 ることができ、これまで人の経験と勘によって行われてい た調整をデータに基づいて行うことができると期待される。

[#] morita16@rcnp.osaka-u.ac.jp



Figure 1: Concept of ion source tuning.

一方でこの手法で調整を行うためにはパラメーターの 調整によって位相空間分布がどのように変動したかを把 握する必要があるため、エミッタンスを何度も測定する必 要がある。また、調整を迅速に行い、学習用のデータを 短期間に蓄積させるためには高速でのエミッタンス測定 が必須である。

3. Pepper-Pot Emittance Monitor (PPEM)

今回、高速でのエミッタンス測定を実現するため、 Pepper-Pot Emittance Monitor(PPEM)[3]の開発を行った。

PPEM はペッパーポットマスクと呼ばれる格子状に穴の開いた金属板によってビームを切り出し、下流の蛍光 面で可視光化し、その像をカメラで得ることで位相空間 分布を求めるものである。像とペッパーポットマスクの穴 の位置を対応させることで(x,y)の情報を得ることができ、 蛍光面でのビームの広がりから(x',y')の情報を得ること ができる(Figure 2)。RCNP で開発を行っている PPEM で は、ペッパーポットマスクの穴の間隔は 3mm、ペッパー ポットマスクから蛍光面までの距離は 50mm で設計され ている[4]。



Figure 2: Concept of Pepper-Pot Emittance Monitor.

PPEM の特徴はペッパーポットマスクによってビームを 切り出すことでスリット式 Emittance Monitor のようにスリッ トを動かす必要がなく、一度に 4 次元の位相空間情報を 得ることができる。そのため、高速での測定が可能である。 加えて Beam Profile Monitor(BPM)に蛍光版と CCD カメ ラを用いることでリアルタイムの測定を実現することがで きる。現在、RCNP では毎秒 4 回のエミッタンス測定を実 現している[5-7]。

一方で PPEM はマスクの隣り合う穴から出たビームが 被らないようにする必要があり、測定できるエミッタンスは 設計によって制限される。そのため、1 台の PPEM では 広い範囲のエミッタンス測定を行うことができない。 RCNP で開発を行っている PPEM では、エミッタンスの大 きなビームの測定を想定しているため30 π mm mrad以 下の測定を行う際に分解能が足りず、正確な測定を行う ことができない。Figure 3 に横軸にシミュレーションで仮 定したエミッタンス値を、縦軸に RCNP の設計で測定を 行った際の測定値をプロットし30πmm mrad以上の領 域に直線フィッティングをしたものを、Fig. 4 に同様の結 果を30 π mm mrad以下のみをプロットし、直線フィッティ ングしたものを示す。フィッティングパラメーターp0はy切 片を、pl は直線の傾きのフィッティング結果を表している。 また、エミッタンスは 2σで 15mm のビーム径を持つ楕円 を仮定し、角度方向の値を大きくすることでエミッタンスを 変えている。この結果から RCNP の設計では、 30 π mm mrad以下の測定ができないとこが言える。

そこで今回、30 π mm mrad以下の低エミッタンスビー ムの測定を目指した開発を行った。

PPEM の分解能を決める要素は主に

- 1. ペッパーポットマスクの穴の間隔(dx)
- 2. ペッパーポットマスクから蛍光面までの距離(d)

3. CCD カメラの分解能 である。



Figure 3: Simulation results of emittance measurements in the design of RCNP.

(Fitting from 30π mm mrad to 250π mm mrad)



Figure 4: Simulation results of emittance measurements in the design of RCNP.

(Fitting from 5 π mm mrad to 30 π mm mrad).

PPEM ではペッパーポットマスクの穴の位置でしか ビームを切り出すことができないため、穴の間隔が (x,v) の分解能を決める。一方で穴の間隔が狭まると、隣り合う 穴から出たビームが重なり合い、正確な測定ができなく なる。また、ペッパーポットマスクから蛍光面までの距離 は得られた像 1pixel 当たりの角度を決め、角度分解能に 影響を与える。ペッパーポットマスクから蛍光面までの距 離が長いほど(x',y')の角度分解能は上がるが、測定可 能な最大角度は小さくなるため、ペッパーポットマスクの 穴の間隔の時と同様にビームが重なり合い、測定が正確 に行えなくなる危険性が上がる。CCD カメラの解像度は 高ければ高いほど、(x',y')の角度分解能が上がる。また、 CCD カメラの解像度を上げても測定可能な最大角度に は影響しないが、一方で得られる像のデータが大きくなり、 読み込みや解析にかかる時間が増加し、リアルタイム性 を損なう可能性がある。そのため、これらを総合的に精査 し、低エミッタンスビームのリアルタイム測定に耐えうる分 解能を実現することが重要である。Table 1,2 にペッパー ポットマスクから蛍光面までの距離(d)ごとの角度分解能 $(\Delta x')$,測定可能な最大角度 (x'_{max}) をまとめた。ただし、 ペッパーポットマスクの穴の間隔をdx(mm)とし、カメラの 解像度は Table 1 では 50µm/1pixel、Table 2 では 20µm/1pixel である。

Table 1: Design and Angular Resolution (50 µm / 1 pixel)

d(mm)	$\Delta x'$ (mrad)	$x'_{\max}(mrad)$
50	1	$10 \times dx$
100	0.5	$5 \times dx$
150	0.33	$3.3 \times dx$
200	0.25	$2.5 \times dx$

Table 2: Design and Angular Resolution (20 μ m / 1 pixel)

d(mm)	$\Delta x'$ (mrad)	$x'_{\max}(mrad)$
50	0.4	$10 \times dx$
100	0.2	$5 \times dx$
150	0.133	$3.3 \times dx$
200	0.1	$2.5 \times dx$

今回、半径15mmの位相空間上で楕円となるビームを 仮定し、5 π mm mrad以上のエミッタンス測定を実現し、 測定可能な最大角度が7.5 mrad 以上となるように設計を 行う。今回、ビーム径が大きいほど角度分解能が必要と なること、位相空間上でビームが回転することを考慮し、 RCNPの加速器を基準に要求性能を決定した。この条 件を満たすものは以下の三つである。

- 1. $d = 100mm, dx = 1.5mm, 20\mu m/1 pixel$
- 2. $d = 100mm, dx = 2.0mm, 20\mu m/1 pixel$
- 3. $d = 200mm, dx = 3.0mm, 50\mu m/1 pixel$

このうち、3は位置分解能が低く、調整中にビームが絞られる可能性があることを考慮し、今回は候補から外し、 1,2 について Fig. 3, Fig. 4 の場合と同様に 2σで 15 mm のビーム径を持つ楕円をエミッタンスとして仮定し、角度 方向の値を大きくすることでエミッタンス値を変えてシミュ レーションを行い、横軸に仮定したエミッタンス値、縦軸 にそのビームを測定した際の値をプロットし直線フィッ ティングをおこなった。その結果をそれぞれ Fig. 5, Fig. 6 に示す。フィッティングパラメーターp0 は y 切片を、p1 は 直線の傾きのフィッティング結果を表している。



Figure 5: Simulation results of emittance measurements in the design 1.

(Fitting from 5π mm mrad to 30π mm mrad)



Figure 6: Simulation results of emittance measurements in the design 2.

(Fitting from 5 π mm mrad to 30 π mm mrad)

この結果から 1,2 の条件による大きな違いはなく、どち らも測定に耐えうる分解能を有しているといえる。

今回の設計で、低エミッタンスビームの測定が可能な 設計で測定を行った際に、エミッタンスの大きなビームが 来ていると、隣り合う穴から出たビームが重なり合い、正 確な測定ができなくなってしまう。そのため、広い範囲で 測定を行うためにはエミッタンスの小さいエミッタンス測 定用と大きなエミッタンス測定用をうまく使い分ける必要 がある。最も簡単な方法は2台用意し、使い分けることだ が、その場合、それぞれで別の位置に設置することにな り、測定位置が大きく変わってしまう。また、MCP や蛍光 面、CCD カメラをそれぞれ個別に用意する必要はなく、 同一のものを使うことができれば測定値が大きく安価に 済ますことができる。そこで、ペッパーポットマスクをビー ムのエミッタンスによって差し替えることで下流の MCP や 蛍光面、CCD カメラを共通で使用し、幅広い範囲のエ ミッタンス測定を行う PPEM を考案した。この装置では、 測定位置はおおきくかわらず、安価に幅広い範囲のエ ミッタンスが測定できる。その概略図を Fig. 7 に示す。



Figure 7: Measurement of wide range emittance by replacing the pepper pot mask.

4. まとめ

現在、イオン源調整への機械学習の応用を行ってい る。機械学習の大きなメリットとして多くの情報を処理でき るという点があげられ、そのメリットを生かしてパラメー ターとの相関を探り、これまで経験と勘に頼っていた調整 を数値的に処理することが期待される。機械学習の実装 のためにはビームの状態を迅速に測定することが求めら れる。そこで今回、PPEM で低エミッタンスビームの測定 を行うために必要な条件を精査し、低エミッタンスビーム 測定用の PPEM の設計を行った。また、ペッパーポットマ スクを差し替えることで低エミッタンスビーム用と高エミッ タンス用を切り替え、一台で幅広い範囲のエミッタンスに 対応できる PPEM を設計した。

謝辞

本研究は、大阪大学核物理研究センター(RCNP)研究プロジェクト、大阪大学データビリティフロンティア機構 学際プロジェクトから、多大なご協力を頂きました。

また、本研究の一部は、文部科学省「ダイバーシティ 研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」連携型共同研 究助成、および、大阪市立大学戦略的研究(基盤研究) の助成を受けて実施されました。

参考文献

- [1] 斎藤康毅, "ゼロから作る Deep Learning Python で学ぶ ディープラーニングの理論と実装",株式会社オライリー・ ジャパン(2016).
- ジャパン(2016). [2] 城庵颯, "機械学習を使用した KEK Linac 加速器運転調 整システムの開発", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan THPH007.
- [3] M. Dolinska, M. Domke *et al.*, "EMITTANCE MEASURE-MENTS AT THE NEWUNILAC PRE-STRIPPER USING A PEPPER-POT WITH A PC-CONTROLLED CCDCAM-ERA", Proceedings of the 4th European Workshop on Beam Diagnostics and Instrumentation for Particle Accelerators (1999).
- [4] 山根浩義、"ペッパーポット型リアルタイムエミッタンス測定 装置の開発", Proceedings of the 11th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan SAP079.
- [5] Tetsuhiko Yorita *et al.*, "Developments of fast emittance monitors for ion sources at RCNP", Rev. Sci. Instrum., vol. 87, pp. 02B928, 2016.
- [6] 森田泰之, "RCNP におけるペッパーポット型エミッタンス 測定装置のリアルタイム化", Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan TUP079.
- [7] 森田泰之,"重イオン入射ビームの大強度・高輝度化"大阪 大学理学研究科物理学専攻 修士論文(2018).